# ■ 講座 はじめてみよう!高エネルギー密度プラズマ計測

# 5. レーザー宇宙プラズマ計測

# 5. Plasma Diagnostics in Laser Astrophysics

森田太智 MORITA Taichi 九州大学大学院総合理工学研究院 (原稿受付: 2015年12月28日)

高出力レーザー生成プラズマを用いて宇宙の高エネルギー現象を実験室に再現し詳細に計測することで、 様々なプラズマ現象を実験的に研究する手法をレーザー宇宙研究といい、近年広がりつつある宇宙・プラズマ研 究手法の一つです.ここで対象とするプラズマはその速度が数百から数千km/sと比較的大きく、空間スケールは サブミリメートルから数センチメートル程度とレーザー生成プラズマとしては比較的大きいことが特徴です.ま た宇宙では無衝突なプラズマを考えることが多いため、ここで対象とするプラズマ密度は、例えば慣性核融合研 究などと比べて何桁も小さくなります.このようなプラズマについて、光学計測やプローブ計測を用いた温度・ 密度等の計測手法や、プラズマ中における電磁場構造を可視化するための粒子ビーム計測手法(プロトンバック ライト法)について述べるとともに、レーザー宇宙プラズマへの応用例を紹介します.

#### Keywords:

laser astrophysics, plasma diagnostics, high-power laser

## 5.1 レーザー宇宙プラズマ研究

核融合研究に用いられるような数キロジュール以上の出 カエネルギーをもつ大型レーザーを用いることで, 例えば 超新星残骸で観測されるようなおよそ1000 km/s にもなる 高速プラズマ流を生成し、そのプラズマを用いた宇宙の高 エネルギー現象を模擬できる可能性があることは以前から 示唆されていました[1,2].実験室プラズマを用いる利点 としては、多くのプラズマ計測手法を用いて天体の観測で は難しい、 プラズマパラメータ測定とプラズマ構造形成の 可視化を同時に行うことができる点が挙げられます. 宇宙 におけるプラズマは希薄で高温なため粒子間の衝突がほと んど無い無衝突プラズマであることが多く、プラズマ中で は粒子と場の相互作用を理解する必要があります.した がって実験室で類似した現象を研究するには、(1)非常に 高速なプラズマ流を生成しプラズマ同士, またはプラズマ と固体やガスと高速で相互作用させることで無衝突に近い 状態を作り、(2)プラズマの温度・密度・速度等のパラ メータを正確に測定すると同時に(3)無衝突プラズマに特 徴的な電磁場を計測する必要があります.

高速プラズマ流の計測のためには数 ns 程度の時間分解 能と、レーザー生成プラズマは典型的に数mm程度の空間 スケールであるため、数 µmから数百µmの空間分解能で プラズマのパラメータや電磁場構造を計測する必要があり ます.本講座では、まずレーザー宇宙研究でよく用いられ る計測手法を説明し、宇宙プラズマや実験室プラズマで普 遍的に存在する無衝突衝撃波を例として、レーザー生成プ ラズマを用いた研究手法,計測手法の応用について紹介します.

#### 5.2 プラズマ計測

ここではレーザー宇宙プラズマ実験でよく用いられるプ ラズマ計測について説明します.電子密度や密度変化を計 測するためのレーザー干渉法,プラズマ中の電子の熱制動 放射による発光(自発光)計測,局所的な温度・密度等計 測が可能なレーザートムソン散乱法,さらにプラズマ中の 非接触な電磁場計測手法として高エネルギー陽子ビームを 用いたバックライト法(プロトンバックライト法)につい て,それぞれの計測手法,原理を簡単に説明します.

#### 5.2.1 密度計測

電子密度はプラズマの特徴を知る上で最も重要なパラ メータの1つですが、その電子密度の計測によく用いられ る手法として干渉計測があります.干渉計測は、プラズマ だけでなくガス流の非接触計測としても利用され、重力波 検出などの基礎研究のための大型干渉計も建設されていま す.またその手法は一眼レフカメラのオートフォーカスな どにも応用されています.

ここではレーザーを用いた干渉計測の手法について説明 します.干渉法ではレーザー光がプラズマ内を通るときの 位相変化と真空中を通るときの位相変化の違いを計測しま す.干渉計には色々な手法がありますが,図1(a)と1(b) に示したのはMach-Zehnder干渉計,Michelson干渉計と呼 ばれます.どちらも入射レーザーを2つに分離し,計測し

Faculty of Engineering Science Kyushu University, Kasuga, FUKUOKA 818-0135, Japan

author's e-mail: morita@aees.kyushu-u.ac.jp

たいプラズマを通った光と真空中を通る光を重ねること で,2つの位相差を計測します.また図2,3に示したの は Nomarski 干渉計と呼ばれ,計測したいプラズマより十 分大きなビーム径のレーザーをプラズマに入射し,その後 プリズムを用いて分離したビーム同士を偏光子を用いて干 渉させる手法です.Nomarski型ではプリズムを置く距離 *a*と計測点までの距離*b*のみで干渉縞の間隔が決まり,干 渉計を比較的容易に調整できますが,前の2つに比べて視 野を広くとれないという弱点があります.

ここで簡単に干渉法による位相計測から密度を求める方 法を説明しておきます. プラズマは電子・イオン・中性粒 子の混合気体と考えられますが,電離した気体中では光の 屈折はほぼ電子によるものと考えて良く,その屈折率  $\mu$ は電子密度  $n_e$  および入射レーザーに対する臨界密度  $n_c$  を 用いて  $\mu = \sqrt{1 - n_e/n_c}$  と表せます. プラズマを通るビーム と真空中を通るビームの位相差  $\delta\theta$  は,プラズマの厚み l, レーザー周波数  $\omega$  を用いて,

 $\delta\theta = (\omega/c)(l\mu - l)$ 

$$= \frac{\omega}{c} \int (\sqrt{1 - n_{\rm e}/n_{\rm c}} - 1) \,\mathrm{d}l$$
$$\simeq -\frac{\omega}{2n_{\rm c}c} \int n_{\rm e} \mathrm{d}l \,, \qquad (1)$$

となります. ここで c は真空中の光速, n<sub>e</sub> は n<sub>c</sub> に比べて十 分小さいと仮定しました. 式(1)は電子密度と位相差の関 係を示しており,位相差を計測することで,電子の面密度 を求めることができます. さらに,プラズマが軸対称に生 成される場合は,面密度ではなく各空間での密度を見積も ることができます. この場合,位相差と密度の関係は図4 の座標を用いて以下のように表されます.



図1 (a) Mach-Zehnder 干渉計と(b) Michelson 干渉計の配置 例. BS と MR はビームスプリッターとミラーを表す.



図2 Nomarski干渉計の配置図. WP はある分離角で互いに直交 する偏光の2つのビームに分離するウォラストンプリズ ム、PL は偏光板を示す.

$$\delta\theta = -\frac{\omega}{n_c c} \int_0^{\sqrt{a^2 - y^2}} n_e(r) dx$$
$$= -\frac{\omega}{n_c c} \int_y^a \frac{n_e(r) r dr}{\sqrt{r^2 - y^2}}.$$
(2)

この被積分項である電子密度 *n*<sub>e</sub> は, Abel 逆変換を用いる ことで

$$n_{\rm e}(r) = \frac{2n_{\rm c}c}{\pi\omega} \int_r^a \frac{\mathrm{d}(\delta\theta)}{\mathrm{d}y} \frac{1}{\sqrt{y^2 - r^2}} \,\mathrm{d}y. \tag{3}$$

となり、位相差の空間分布から電子密度の空間分布を求め ることができます.

#### 5.2.2 プラズマ自発光

プラズマの自発光を計測することでその構造のイメージ ングや、温度や密度、伝搬速度等を求めることができます. 光学的に厚い、つまり光の平均自由行程がプラズマのス ケールに対して十分小さい場合、自発光は黒体放射とみな すことができますので、輝度温度  $T_b = T_e$  となります. 一 方、宇宙プラズマや比較的密度の低い実験室プラズマで は、光学的に薄く  $T_e \gg T_b$  となり、 $T_e$  は熱制動放射として 電子密度と電子温度の関数で表されます. レーザー宇宙プ ラズマ実験ではおもに光学的に薄い無衝突プラズマを扱う ため、ここでは熱制動放射について考えることとします. Maxwell 分布に従う熱的運動を行う電子が単位体積、単位 時間あたりに放射する熱制動放射エネルギーは以下のよう に表されます[3].

$$\varepsilon_{\nu}^{ff} = \frac{\mathrm{d}W(T_{\mathrm{e}})}{\mathrm{d}V\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\nu}$$
$$= \frac{Z^{2}e^{6}n_{e}n_{i}}{3\sqrt{3}mc^{3}\varepsilon_{0}^{3}\pi^{3/2}}\frac{1}{\sqrt{2mk_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{e}}}} \times \exp\left(-\frac{h\nu}{k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{e}}}\right)g_{\mathrm{ff}} \quad (4)$$



図3 Nomarski 干渉計の設置例.



図4 軸対称なプラズマが生成された場合の断面と、計測用レー ザーの入射方向(1軸).

$$\propto \frac{n_{\rm e}^2}{\sqrt{T_{\rm e}}} \exp\left(-\frac{h\nu}{k_{\rm B}T_{\rm e}}\right) \tag{5}$$

つまり,ある波長における放射エネルギーは電子温度と電 子密度の関数になります.したがって,計測器の絶対感度 (入力光のエネルギーと出力カウントの関係)を較正する ことで,密度・温度の情報を得ることができます.しかし 式(5)からわかるように,電子密度に強く依存するためプ ラズマ自発光から温度を見積もるのは一般的には難しく, 多くの場合発光輝度は電子密度分布を示すことになります.

実験ではプラズマ自発光をナノ秒程度のゲート幅で計測 可能な Intensified Charge Coupled Device (ICCD) カメラ を用いて時間分解したイメージ [Gated Optical Imager (GOI)] またはストリークカメラを用いてプラズマの時間 発展 [Streaked Optical Pyrometry (SOP)] を得ることに なります.特に SOP は、プラズマの伝搬速度を見積もるの に利用できます.ストリークカメラとは、短時間の現象の 時間発展を計測する装置であり、スリット、光電面、掃引 部、蛍光面、および CCD カメラから成ります.前面のス リットを通った空間的に1次元の像は、光電面で電子に変 換され、高速に時間変化する電位差によって掃引され、蛍 光面で光信号に再変換されます.つまり1次元的な像の時 間発展を得ることができます.プラズマの自発光をスト リークカメラで計測することで、ns 以下の短時間の現象で も時間・空間分解してその発展を計測できます.

#### 5.2.3 温度計測

ここでは温度の計測としてよく用いられるレーザートム ソン散乱計測について説明します.レーザートムソン散乱 法とは、プラズマにレーザーを照射し、プラズマ中の電子 によるトムソン散乱光を分光することで、そのスペクトル を計測する手法です.散乱スペクトルはプラズマ状態を強 く反映し、電子温度やイオン温度、電子密度、ドリフト速 度等を局所的に測定することができます.散乱断面積は電 子のランダムな運動による部分( $\sigma_e$ :電子項)と、イオン に追随する電子からの散乱( $\sigma_i$ :イオン項)に分けられ、  $\sigma = \sigma_e + \sigma_i$ となります.

デバイ長 $\lambda_D$ よりも大きなスケールを計測する場合, プラ ズマ中で協同的な運動をする電子による散乱を計測するこ とになり,この場合を協同散乱といいます.一方,デバイ 長よりも小さい空間スケールを計測する場合は,非協同散 乱となり,電子の熱的な運動を直接見ることになります. ここで $\omega = \omega_s - \omega_0$ ,  $\mathbf{k} = \mathbf{k}_s - \mathbf{k}_0$  ( $\mathbf{k}_0$ ,  $\mathbf{k}_s$  は入射レーザーお よび散乱光の波数ベクトル, $\omega_0$ ,  $\omega_s$  はそれぞれの周波 数)とし,散乱パラメータ $\alpha = 1/k\lambda_D$ を定義すると, $\alpha > 1$ の場合は協同散乱, $\alpha \ll 1$ の場合は非協同散乱となります. 一般にレーザー生成プラズマを可視レーザーを用いて計測 する場合, $\alpha > 1$ となり,協同散乱となる場合が多くなりま す.

散乱スペクトル形状は形状因子 S(k,ω) で表され[4],

$$S(\mathbf{k},\omega) = \frac{2\pi}{k} \left| 1 - \frac{\chi_{\rm e}}{\varepsilon} \right|^2 f_{\rm e}\left(\frac{\omega}{k}\right) + \sum_{j} \frac{2\pi}{k} \frac{Z_j^2 n_j}{n_{\rm e}} \left|\frac{\chi_{\rm e}}{\varepsilon}\right|^2 f_j\left(\frac{\omega}{k}\right)$$
(6)

となります.ここで $\chi_{e}$ ,  $\chi_{j}$ は, それぞれ電子, イオンの電 気感受率,  $\varepsilon = 1 + \chi_{e} + \sum \chi_{j}$ ,  $n_{e}$ は電子密度,  $Z_{j}$ ,  $n_{j}$ はイオ ンの平均価数と数密度を示します.式(6)の第1項は電子 項, 第2項はイオン項です.協同散乱の場合, イオン項と 電子項はそれぞれイオン音波周波数( $\omega - \omega_{ac}$ )および電子 プラズマ周波数( $\omega - \omega_{pe}$ )に共鳴周波数があり, ともにダ ブルピークを持つスペクトル形状となります.特にイオン 項では共鳴周波数

$$\omega \sim \omega_{\rm ac} \sim k \sqrt{\frac{ZT_{\rm e} + 3T_{\rm i}}{m_{\rm i} \left(1 + k^2 \lambda_{\rm D}^2\right)}} \tag{7}$$

から電子温度,およびイオン温度を求めることができ,ま た電子項からは電子密度や電子温度を得ることができます.

#### 5.2.4 電磁場計測

#### 5.2.4.1 プロトンバックライト計測

パルス幅が100ピコ秒程度以下の高強度レーザーを薄膜 に照射することで、薄膜表面に付着した水分子等に含まれ る電離した陽子を薄膜表面から垂直方向に加速することが できます.これは、薄膜表面から加速された電子と薄膜表 面の間に生成される強電場によって陽子が加速される現象 で, Target Normal Sheath Acceleration (TNSA) と呼ばれ ます. ここで加速される陽子は数 MeV から数十 MeV のエ ネルギーを持ち、プラズマ中を通過すると、プラズマ中の 電磁場によってその速度方向が変化します。この陽子ビー ムを Radiochromic Film (RCF) 等で計測すると, 電磁場の 影響を受けた陽子ビームのイメージ計測ができます。得ら れた陽子の空間分布からプラズマ中にある電場または磁場 構造を逆算して求める手法が最近用いられています[5]. 図5にその計測配置の例を示します. ここでは金薄膜に レーザーを照射することで陽子ビームを生成し、また別の 高出力レーザーで生成したプラズマ内の電磁場構造を計測 しています. 計測には RCF を用いていますが, 何層にも重



図5 プロトンバックライト計測の配置例.

ねて計測することで, 陽子の透過距離から, 各層の RCF で計測した陽子のエネルギーを知ることができます. 陽子 エネルギーの違いから, プラズマ中の電磁場構造を逆算す ることで電磁場を求めます.

# 5.3 レーザー宇宙プラズマ実験への応用例 5.3.1 実験配置

図6(a)-6(c)に示したのは、レーザー宇宙プラズマ実験 で用いるプラズマ生成用のレーザー照射ターゲットの配置 図の一例です.超新星残骸や太陽系、地球近傍等、宇宙で 普遍的に観測されている無衝突衝撃波の研究のため、実験 室に高速なプラズマ流を生成しています.レーザー生成プ ラズマを相互作用させるため、図のように2枚の薄膜をお よそ4.6 mm 間隔で並べたターゲットを用いて、2枚のう ちの片側にレーザーで照射し、もう一方はレーザー生成高 温プラズマからの輻射によりプラズマ化させることで、対 向するプラズマ流を生成しています.さらに計測手段とし て、ターゲットに対して斜め方向からトムソン散乱計測の ための入射レーザー(TS probe)、ターゲット真横から干 渉計測のためビーム径を拡大したレーザー(Optical probe)を照射し、さらに干渉計測と同じ方向から、プラズ マ自発光による SOP 計測を行いました.

## 5.3.2 無衝突衝撃波の密度計測

衝撃波が生成されると、衝撃波の上流では超音速であっ た流れが下流では亜音速となり、下流領域は圧縮され、最 大で4倍程度の大きな密度変化が生じます.図7は、対向 プラズマ中において生成された衝撃波の干渉計測結果で す.図7(a)は真空中での計測であり、プラズマが無いため 干渉縞は空間上すべての場所でほぼ同じ方向を向いていま すが、プラズマが生成されると位相変化が生じるため、 図7(b)のように干渉縞が曲がります.ここで示した干渉 像はレーザー照射から9ns後の計測結果になります.この 図では、z=3mm付近で干渉縞が急激に変化していること がわかります.この実験では、z=0mmおよびz=46mm



図6 (a)トムソン散乱計測のためのレーザー照射ターゲット、 プラズマ生成用レーザー(HIPER laser),計測用レーザー (TS probe),の配置例と(b)横からおよび(c)上から見た 図. (d)計測用レーザーの拡大図.空間精度は、奥行き方向 に 300 µm,上下方向に 50 µm 程度であることを示す. Reprinted with permission from[6]. Copyright 2013, AIP Publishing LLC.

にCH薄膜を設置し, z = 0 mm, x = 2.5 mmの位置を高出力 レーザーで照射しています.実験で用いたレーザーは上海 光机所の神光 II レーザー(中国)という大型レーザー で,出力エネルギーはおよそ1 kJ,パルス幅1 ns,波長は 351 nm です.

空間上の位相変化を計算し、軸対称なプラズマが生成さ れていると仮定すると、5.2.1節で説明したように、電子密 度を見積もることができます.図8は図7(b)のz=3mm 付近の電子密度分布を示します。z=3.2 mm で密度が急激 に上昇しおよそ4倍になっていて, 左側が衝撃波の上流, 右側が下流に対応することがわかります。このように軸対 称に近い密度構造がある場合、干渉計測では、プラズマの 全体的な構造に加え、局所的な密度を見積もることができ ます.しかし計測可能な密度領域はそれほど大きくなく, 計測レーザー波長と光学計測配置に依存します. 密度が高 く屈折率が大きすぎる場合はレーザーが計測できず,図7 (b)で干渉縞の無い領域(レーザー照射面やターゲット薄 膜付近)のようになり,解析不能となります.また密度が 低い場合は、位相変化が小さいことから解析が難しくなり ます. この実験で用いた計測レーザー波長 532 nm, 視線方 向のプラズマサイズ~5mm 程度では、計測可能な密度は およそ 10<sup>17-19</sup> cm<sup>-3</sup> 程度となります. したがって, さらに 低密度を計測するには長波長が必要であり, 高密度では, 屈折した光を計測するためにレンズを近距離に設置したり 短波長を用いるなど、計測対象に応じた設定が必要となり ます.

#### 5.3.3 自発光によるプラズマの時間発展計測

**図9**は、レーザー照射によって、対向プラズマが生成されている様子を示す SOP 計測の結果です. *z*=0, *t*=0 で



図7 干渉計測による結果. (a)プラズマが無い場合と(b)プラズ マ生成後の干渉像を示す. (b)は z = 0 mm, x = 2.5 mm の位置に高出カレーザーを集光した後, 9 ns 経過後のデー タである[7].



図8 図7(b)で計測された衝撃波周辺のz軸に沿った密度分布.



図9 図6のz軸にストリークカメラのスリットを合わせ、2枚 の薄膜間に伝搬するプラズマの自発光を計測するSOPの結果。

レーザーが薄膜ターゲットに照射され、プラズマが生成さ れます.また、z=4.6 mm に置いたもう一枚の薄膜からも プラズマが生成され、逆向きに伝搬している様子がわかり ます.ここでプラズマ生成に用いたレーザーは大阪大学 レーザーエネルギー学研究センターの激光 XII 号で、合計 およそ 360 J、パルス幅 0.5 ns、波長 351 nm の高出力レー ザーです.この図からわかるように、レーザーを照射した 直後から非常に高速なプラズマが噴出し、その速度はおよ そ 670 km/s とわかります.また 15 ns 後から右方向に伝搬 する密度構造がz=2 mm あたりに観測され、これが前節で 述べた衝撃波であると考えられます.このように SOPを用 いることで、プラズマ生成やプラズマ中の構造形成の時間 発展を知ることができます.

#### 5.3.4 レーザートムソン散乱による衝撃波計測

衝撃波は、その上流・下流において、密度や温度、速度 の変化を伴います.したがって、衝撃波の上流、下流にお いて上記のパラメータを局所的に計測することは、衝撃波 の実験研究において非常に重要となります、レーザートム ソン散乱法は、プラズマ中にレーザーを集光して、電子に よる散乱光を計測するため、レーザー集光径程度の空間分 解能を持つほぼ局所的な計測になります [図6(d)参照]. 実際に行った計測配置は図6に示した通りです. ターゲッ トに対して斜めから計測用レーザーを集光照射し、レー ザーに沿った空間位置に於けるスペクトルを示したのが 図10(b)です。縦軸はレーザーに沿った空間を表し、その 座標を図6に示したx,zを用いて表しています. 横軸は散 乱光の波長を示します. 図10(a)は、 プラズマではなく、 中 性の窒素ガスからのレイリー散乱です. レイリー散乱は中 性原子に束縛された電子による散乱で、弾性散乱のため波 長は入射レーザーと変わりません. 波長方向の広がりは分 光器の分解能を示し、この波長方向の広がりを考慮して、 図10(b)のトムソン散乱スペクトルを式(6)でフィッティン グすることで、電子温度・イオン温度・電離度を求めるこ とができます. 図10(b)から明らかなように, x = -0.5 mm付近で急激にスペクトル形状が変化しています. 一般的に スペクトルが広がる程高温を意味し、入射レーザー波長 (532 nm)からのずれが大きいほど、流速が大きいことを 示します. つまり, P1 は衝撃波の上流, P2 は下流を表して いると考えられます.また、レイリー散乱とトムソン散乱



図10 (a)窒素ガスによるレイリー散乱スペクトルと(b)トムソン 散乱のイオン項スペクトルの計測結果. Reprinted with permission from [6]. Copyright 2013, AIP Publishing LLC.

の散乱断面積比は既知であるため、それぞれのスペクトル 強度を比較することで、電子密度を求めることができま す.

図11 (a), 11 (b)はそれぞれ図10 (b)で示した場所 P1 および P2 におけるスペクトルと, P1 および P2 におけるスペクトル と, 図10 (a)の広がりをガウス関数で評価し,式(6)の畳み 込み積分関数でフィッティングした結果(Best fit),およ びそのときの式(6)(Theoretical Func.)をプロットしたも のです.この図から得られた電子・イオン温度,ドリフト速 度は上流で, $T_e = 24 \text{ eV}, T_i = 20 \text{ eV}, v_d = 89 \text{ km/s},下流で$  $<math>T_e = 100 \text{ eV}, T_i = 71 \text{ eV}, v_d = 18 \text{ km/s} となり[6],衝撃波$ 下流において明らかにプラズマが加熱されていることを示しています.

#### 5.3.5 プロトンバックライトによる衝撃波の計測

最後に,強い電場を伴う静電無衝突衝撃波の生成とその プロトンバックライト計測結果について述べます.5.1節 で述べたように,無衝突衝撃波は,粒子同士の衝突がほと んど無い無衝突なプラズマ中で生成されるため,粒子と電 磁場の相互作用が重要となります.この場合,超音速流を 散逸するのに十分な電磁場が必要です.ここでは電場が散 逸に寄与する静電衝撃波を考えます.静電衝撃波では,ほ ほ1次元的な電場構造が衝撃波の上流 – 下流の遷移領域に 生成されていると考えられます.



図11 2点(a)P1, (b)P2におけるスペクトル形状. Reprinted with permission from[6]. Copyright 2013, AIP Publishing LLC.



図12 陽子ビームによるイメージング結果. (a)-(d)はそれぞれ 10 ns後の陽子のエネルギー 4.7 MeV, 7.0 MeV, 8.8 MeV, 10.4 MeV による結果.

図12に示したのは、プラズマ中に生成された静電衝撃波 に真横から陽子ビームを入射したときに得られた陽子分布 イメージです. この衝撃波は静電衝撃波と考えられるため [8],衝撃波近傍での上流,下流領域に平坦なポテンシャ ル構造を仮定し、非常に薄い(粒子の平均自由行程より短 い、この場合数µm程度)遷移領域を考えます.陽子が高エ ネルギーになるほど電場による屈折が小さく, RCF 上に形 成される構造は小さくなると考えられます。図13は、入射 陽子ビームのエネルギーの関数として, RCF 上に作られる 構造(RCF 陽子の変位量)を計算したものです. このよう に、入射エネルギーの違い、つまり実験的には多層に並べ た RCF の何層目かに計測された構造の幅を比較すること で、プラズマ中の衝撃波の幅を見積もることが可能となり ます.実際にこの手法で見積もった衝撃波の幅はおよそ 2 µm となり、典型的な粒子間の平均自由行程~100 µm と 比較すると極端に短く、ここで計測した構造は無衝突衝撃 波であることを示唆しています.

#### 5.4 まとめ

本章で紹介したように、レーザー宇宙研究では数 mm 程度の空間スケールの高速な流れを可視化するため、数ナ ノ秒程度の時間分解・数µmから数百µmの空間分解能で プラズマのパラメータや電磁場構造を計測する必要があり ます.またレーザー宇宙研究の特色として、(1)プラズマ のイメージング計測,(2)局所的な計測,(3)電磁場計測を すべて同時に行うことが可能で、これは宇宙での観測や衛 星による"その場"計測と比べたとき、レーザー宇宙研究の 利点となります. ここで述べた干渉計測, 自発光計測, レーザートムソン散乱計測,プロトンバックライトは、上 記3点を行う上で非常に有用な計測です。なお、本章では 述べませんでしたが、磁場計測手法として、レーザーを用 いたファラデー回転計測[9,10]や磁気プローブによる直接 計測等も広く利用されています[11]. このように多くの計 測を同時に行うことで、レーザー宇宙研究は、宇宙の観測 や数値計算だけでは解釈の難しい物理現象を解明できる可



図13 (a) RCF 上に生成される陽子ビームのイメージのエネル ギー依存性の計算結果.(b)-(e)計測される陽子エネル ギー(4.7, 7.0, 8.8, 10.4 MeV)が RCF 上に形成する陽子 の空間分布.

能性を秘めています.

#### 謝辞

大型レーザー運転に関して、大阪大学レーザーエネル ギー学研究センターの激光 XII 号レーザー、上海光机所の 神光 II レーザー、およびローレンスリバモア国立研究所の Jupiter レーザー施設の多くの技術者、研究者に感謝致しま す.ドイツ HDZR の高部英明氏、大阪大学の坂和洋一 氏、佐野孝好氏、九州大学の富田健太郎氏、国立天文台の 加藤恒彦氏、米国ローレンスリバモア国立研究所の H.-S. Park 氏、B. Remington 氏、N.L. Kugland 氏、台湾国立中央 大学の蔵満康浩氏、核融合科学研究所の森高外征雄氏、英 国 Oxford 大学の G. Gergori 氏、英国 York 大学の N. Woosley 氏、フランス LULI の M. Koenig 氏、フランスパリ天文 台の C. Michaut 氏に感謝します.またそれ以上に多くの学 生の助けにより、大型レーザー実験を行うことができまし た.感謝いたします.

本章で紹介した研究の一部は日本学術振興会科学研究費 補助金基盤研究(B)(21340172,24340141),特別研究員奨 励費(11J06987),U.S. Department of Energy Contract No. DE-AC52-07NA27344,およびレーザーエネルギー学研究 センター共同利用・共同研究からの助成のもとで行われま した.感謝いたします.

# 参考文献

- [1] B. Remington et al., Rev. Mod. Phys. 78, 755 (2006).
- [2] H. Takabe *et al.*, Plasma Phys. Controll. Fusion **50**, 124057 (2008).
- [3] G.B. Rybicki and A.P. Lightman. *Radiative Processes in Astrophysics* (Wiley-VCH, 1985).
- [4] J. Sheffield et al., Plasma Scattering of Electromagnetic Radiation, Theory and Measurement Techniques. (Academic



Press, 2011) Second Edition.

- [5] N.L. Kugland et al., Rev. Sci. Instrum. 83, 101301 (2012).
- [6] T. Morita et al., Phys. Plasmas 20, 092115 (2013).
- [7] T. Morita et al., Phys. Plasmas 17, 122702 (2010).
- [8] T. Morita et al., J. Phys.: Conf. Ser. 688, 012071 (2016).
- [9] T. Pisarczyk et al., J. Soviet Laser Res. 11, 1 (1990).
- [10] M. Borghesi et al., Vehn. Phys. Rev. Let. 80, 5137 (1998).
- [11] G. Gregori *et al.*, Nature **481**, 480, (2012).